

テーマ番号 (M4 1 0) テーマ名 (マイクロ加工・組立試作システムの研究)

企業名 (セイコーインスツルメンツ株式会社)

主要論文

- 1) 須田正之、中島邦雄、古田一吉、光岡靖幸、作原寿彦、安宅龍明：“Electrochemical and Optical Processing of Micro Structures by Scanning Probe Microscopy(SPM)”, MEMS'96, 1996年2月11日
- 2) 作原寿彦、須田正之：“マイクロ電解加工・マイクロ光加工”、エレクトロニクス 1997年4月号、1997年4月1日
- 3) 谷 和夫、鈴木瑞明、古田一吉、作原寿彦、安宅龍明：“DEVELOPMENT OF A NEW TYPE PIEZOELECTRIC MICROMOTOR”,(MEMS'97),1997年1月27日
- 4) 光岡靖幸、中島邦雄、千葉徳男、村松 宏、安宅龍明：“NAMOFABRICATION USING SCANNING NEAR-FIELD OPTICAL MICROSCOPY”,1998 Microprocesses and Nanotechnology Conference, 1997年7月16日
- 5) 古田一吉、石川雄一、御厨美和、高橋裕一郎：“The Microfactory System in National R & D Project of MITI”, International Workshop on Microfactories(IWFMF'98) 1998年12月7日
- 6) 安宅龍明：“マイクロ電解加工”、機械と工具、1998年6月号、1998年6月1日
- 7) 前田英孝、谷 和夫、鈴木瑞明、鈴木陽子、作原寿彦：“圧電型マイクロモータの開発”、マイクロメカトロニクス,Vol.42,No.4, 1998年12月21日
- 8) 作原寿彦：“走査型顕微鏡技術 (SPM) を用いた微細加工”、SUT BULLETIN 科学教養誌、1999年8月1日
- 9) 光岡靖幸、中島邦雄、作原寿彦：“近視野光のフォトレジスト露光特性”、電気学会誌 E センサ・マイクロマシン準部門誌、2000年2月1日
- 10) 渡邊直哉、須田正之、古田一吉、作原寿彦：“FABRICATION OF MICRO PARTS USING ONLY ELECTROCHEMICAL PROCESS”,MEMS 2001, 2001年1月21日

主要特許

- 1) 須田正之、作原寿彦、安宅龍明：“電解加工法及び電解加工装置”、特願平 09-78406(1997年3月28日)
- 2) 鈴木瑞明、谷 和夫：“小型回転式アクチュエータの強震周波数補正方法”、特願平 09-140713(1997年5月29日)
- 3) 入江礼子、須田正之、作原寿彦、安宅龍明：“部品製作方法および部品製作装置”、特願平 09-332902(1997年12月3日)
- 4) 入江礼子、須田正之、中島邦雄、作原寿彦、安宅龍明：“電解加工方法及び電解加工装置”、特願平 10-53909(1998年3月5日)
- 5) 須田正之、入江礼子、作原寿彦、安宅龍明：“電気化学 STM 探針の製造方法”、特願平 10-53907(1998年3月5日)
- 6) 須田正之、入江礼子、古田一吉：“塗布方法及び塗布装置”、特願平 10-253469(1998年9月8日)
- 7) 入江礼子、須田正之、古田一吉：“加工方法および加工装置”、特願平 11-26725(1999年2月3日)
- 8) 須田正之、入江礼子、古田一吉：“加工電極製作方法”、特願平 11-26727(1999年2月3日)
- 9) 須田正之、入江礼子、古田一吉：“加工電極製作方法および加工電極製作装置”、特願平 11-70928(1999年3月16日)
- 10) 入江礼子、須田正之、古田一吉：“回折格子製作方法および製作装置”、特願平 11-318338(1999年11月9日)